

ナノテクノロジープラットフォームの共用設備(名古屋工業大学)

(平成30年 4月)

・以下の料金には30%の「一般管理費」が含まれています。

・成果公開と成果非公開については、ホームページ(<http://nano.web.nitech.ac.jp/>)をご覧ください。

装置名	メーカー・型番	性能・機能	受託試験料金	
			(基本料金、税込)	(追加料金、税込)
プラズマ・ガス凝縮クラスター堆積装置	日本ビーテック 特別仕様	クラスターサイズ 直径3~15nm 直流マグネトロンスパッタリング方式	成果公開:22,854円 成果非公開:114,270円	
高分解能透過電子顕微鏡	日立製作所(株)社製 HF-2000	冷陰極電界放出型、加速電圧:200 kV 分解能:0.1 nm、EDX分析 スロースキャンCCDカメラ	成果公開:14,612円 成果非公開:73,060円	
メスパウアー分光装置	ラボラトリ・イクイップメント LN-6400 (複合システム)、他	測定可能原子核: ⁵⁷ Fe 核, ¹¹⁹ Sn 核 透過法、内部転換電子検出法	成果公開:14,040円 成果非公開:140,400円	液体ヘリウム使用料 9,100円/測定
PLスペクトル・PL寿命測定装置	自作	励起レーザー(連続波:405、532、596、633nm、ナノ秒パルス:532nm) 470mmシングルモノクロメータ 電子冷却CCD検出器+光電子増倍管 プリアンプ、デジタルオシロスコープ クライオスタット(4.2K~300K)	成果公開:8,970円 成果非公開:44,850円	成果公開:4,212円/時間 成果非公開:42,120円/時間 低温測定:36,400円/試料 (温度変化測定は時間で加算)
UV/VIS/NIR分光光度計	日本分光製 V570	付属絶対反射率測定装置ARN475	成果公開:5,278円 成果非公開:26,390円	成果公開:1,404円/時間 成果非公開:14,040円/時間 低温測定:36,400円/試料 (温度変化測定は時間で加算)
3次非線形感受率測定装置	自作	Zスキャン方式	成果公開:11,024円/試料/波長 成果非公開:55,120円/試料/波長	
高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)社製 PMF-3000	1MHz~3GHzの広帯域透磁率測定 試料サイズ5~6(W)×5(L)×1mm(t)	成果公開:8,398円 成果非公開:41,990円	
振動試料型磁束計	東英工業(株)社製 VSM-5	最大印加磁場 1.6 T	成果公開:9,906円 成果非公開:49,530円	
高感度SQUID磁化測定装置	日本カンタムデザイン(株)社製 MPMS5	最大印加磁場 5 T	成果公開:14,040円 成果非公開:70,200円	
スパッタリング蒸着装置	アルバック社製 SPC-2000HC	13.56MHz 200W	成果公開:18,564円 成果非公開:92,820円	
中規模カーボンナノファイバー室温合成装置	自作	カーボンナノファイバー室温合成速度:10 nm/min以上 試料サイズ:1インチ程度以下	成果公開:2,938円 成果非公開:29,380円	
単結晶X線構造解析装置	(株)リガク社製 Mercury	Cu線源とMo線源に対応、出力 18kW、	成果公開:6,578円 成果非公開:32,890円	依頼測定でデータ解析も希望される場合には、成果非公開1件につき別途13,000円、成果公開で1,300円を加算する。
質量分析装置(ESI-MS)	Micromass社製 ECT	イオン化法:ESI APCI、質量範囲:10~40000 Da、分解能:5000 (FWHM)	成果公開:5,434円 成果非公開:27,170円	
電子スピン共鳴装置	日本電子(株)製 JES-RE1X	周波数:8800~9600MHz(Xバンド)、出力:0.1μW~200mW可変	成果公開:7,150円 成果非公開:35,750円	依頼測定でデータ解析も希望される場合には、成果非公開1件につき別途13,000円、成果公開で1,300円を加算する。
原子間力顕微鏡	島津製作所社製 FTM-9600	ナミックモード、位相モード、電流モード、水平力モード、磁気力モード、表面電位モード、分解能:水平0.2nm 垂直0.01nm	成果公開:7,150円 成果非公開:35,750円	依頼測定でデータ解析も希望される場合には、成果非公開1件につき別途13,000円、成果公開で1,300円を加算する。
QCM電気化学システム	(株)北斗電工製 HQ-101C	電圧・電流・時間の測定に加えて、ごく微小な質量変化を同時に測定可能、発振周波数:10MHz	成果公開:7,150円 成果非公開:35,750円	依頼測定でデータ解析も希望される場合には、成果非公開1件につき別途13,000円、成果公開で1,300円を加算する。
高精度ガス/蒸気吸着量測定装置	日本ベル株式会社製 BELSORP-max	細孔分布:直径0.35~500nm、最小比表面積:0.01m ² /g(N ₂)	成果公開:7,150円 成果非公開:35,750円	依頼測定でデータ解析も希望される場合には、成果非公開1件につき別途13,000円、成果公開で1,300円を加算する。

真空蒸着装置	シンク社製 SK-80K	マイカ基板サイズ:15×15mm(標準)、 マイカ厚み:0.1~0.15mm、 金膜厚:100~150nm	成果公開:7,150円 成果非公開:35,750円	依頼測定でデータ解析も希望される場合には、成果非公開1件につき別途13,000円、成果公開で1,300円を加算する。
特型表面ナノ構造形成装置	ULVAC社製 特型	標準2インチ基板、超斜め入射イオンビームによるマスクレスの表面ナノ構造・ナノドット形成可能、組成制御可能、高分子材料の加工可能	成果公開:10,933円 成果非公開:109,330円	
グラフェン・カーボンナノチューブ合成装置	自作特型	CVDによるグラフェン、単層CNTの合成	成果公開:2,249円 成果非公開:22,490円	
太陽電池評価システム	分光計器社製	擬似太陽照射装置(キセノン150W) I-Vテスタ(太陽電池出力測定、ダイオード出力測定、環境設定) ハイパーモノライトシステム(量子効率、分光感度測定)	成果公開:17,810円 成果非公開:178,100円	
特型透過電子顕微鏡装置	日本電子社製 JEM-2010 +特型試料ステージ	ピエゾ駆動探針を用いたナノ領域の電気特性、機械特性評価とその結晶構造との関係評価、その場抵抗加熱	成果公開:15,704円 成果非公開:78,520円	
	日本電子社製 JEM-2100F +特型試料ステージ	FE型電子銃、他は上記と同じ	成果公開:39,624円 成果非公開:198,120円	
特型走査電子顕微鏡装置	日本電子社製 JSM-5600 +特型試料ステージ	ピエゾ駆動探針装備、電気・機械特性測定、その場抵抗加熱	成果公開:2,444円 成果非公開:24,440円	
超精密電子材料基板平坦化装置	MAT社製	基板直径2インチ以下。場合により8インチまで要相談。小径加工(10mm)であれば0.1度刻みで面方位制御可能。	成果公開:14,040円 成果非公開:140,400円	成果公開:1,404円/時間 成果非公開:14,040円/時間
精密形状測定・局所磁気測定・局所電気特性評価装置	日本電子社製 JSPM-5200TM	特型、分解能:原子分解能、CNF探針装備 測定モード:形状、電気特性、磁気特性測定	成果公開:2,470円 成果非公開:24,700円	
原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子社製 JEM-ARM200F	冷陰極電界放出形電子銃、加速電圧:80~200kV 搭載分析装置:エネルギー分散形X線分析装置(EDS)、電子線エネルギー損失分光器(EELS)、デジタルCCDカメラシステム	成果公開:45,708円 成果非公開:228,540円	